(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2007 年8 月9 日 (09.08.2007)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2007/088927 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/677 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2007/051693

(22) 国際出願日: 2007 年2 月1 日 (01.02.2007)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2006-025095 2006 年2 月1 日 (01.02.2006) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): オリンパス株式会社 (OLYMPUS CORPORATION) [JP/JP]; 〒1510072 東京都渋谷区幡ヶ谷２丁目４３番２号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 中村 郁三 (NAKAMURA, Yuzo) [JP/JP]; 〒1510072 東京都渋谷区幡ヶ谷２丁目４３番２号 オリンパス株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 棚井 澄雄 , 外 (TANAI, Sumio et al.); 〒1048453 東京都中央区八重洲２丁目３番１号 Tokyo (JP).

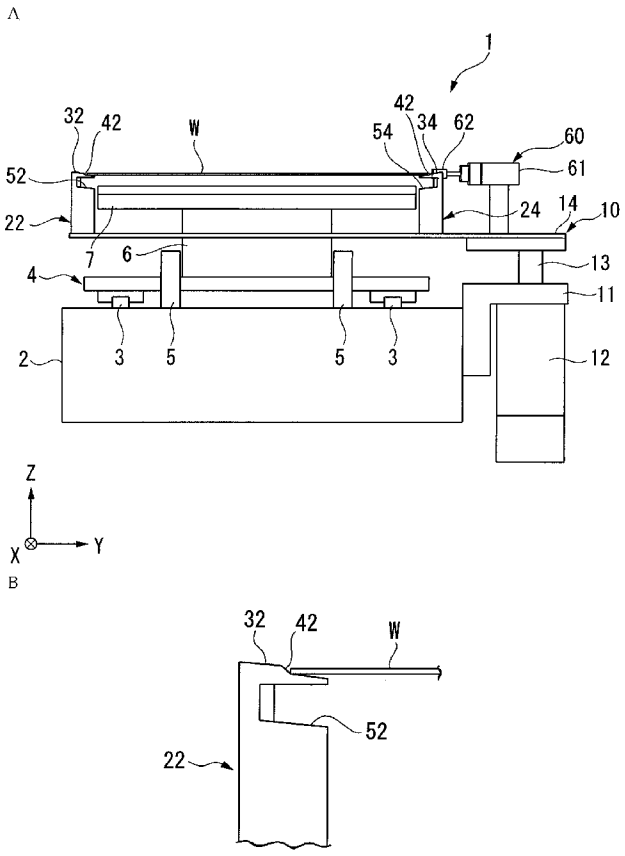
(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK,

/続葉有/

WO 2007/088927 A1

(54) Title: SUBSTRATE EXCHANGING APPARATUS, SUBSTRATE PROCESSING APPARATUS, AND SUBSTRATE INSPECTION APPARATUS

(54) 発明の名称: 基板交換装置及び基板処理装置並びに基板検査装置



(57) Abstract: A substrate exchanging apparatus is provided in which a first substrate received from a first transporter is transferred to a second transporter and a second substrate received from the second transporter is transferred to the first transporter. The substrate exchanging apparatus comprises the second transporter that can move forward and backward in the direction perpendicular to a stacking direction of the first and second substrates, a support member that can move relatively to the second transporter in the stacking direction of the substrates, a first holding member that can hold one of the first and second substrates and is provided on the support member, and a second holding member that can hold the other one of the first and second substrates and is provided on the support member, apart from the first holding member with a certain distance in the stacking direction of the substrates. When one of the first and second holding members is used for receiving the first substrate from the first transporter, the supporting member and the second transporter are relatively moved so that the other one of the first and second holding members is used for the first transporter receiving the second substrate.

(57) 要約: 第１の搬送部から受け取った第１の基板を第２の搬送部に渡し、前記第２の搬送部から受け取った第２の基板を前記第１の搬送部に渡す基板交換装置であって、前記第１の基板と前記第２の基板の積層方向に直交する方向に進退可能な前記第２の搬送部と、前記基板の積層方向に前記第２の搬送部に対して相対的に移動可能な支持部材と、前記支持部材に設けられ、前記第１の基板または前記第２の基板の一方を保持可能な第１保持部と、前記支部部材において前記第１保持部から

/続葉有/

SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

２文字コード及び他の略語については、定期発行される各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

前記基板の積層方向に所定距離だけ離れて設けられ、前記第１の基板または前記第２の基板の他方を保持可能な第２保持部と、を備え、前記第１保持部と前記第２保持部の一方を前記第１の搬送部からの前記第１の基板の受け取りに使用したときに、前記第１保持部と前記第２保持部の他方を前記第１の搬送部による前記第２の基板の受け取りに使用するように、前記支持部材と前記第２の搬送部とを相対的に移動させる。